L6 ANSWER 19 OF 33 HCA COPYRIGHT 2001 ACS Full-text AN 114:193378 HCA

TI Aromatic acid amine salt multilayer film with structural periodicity

IN Takeya, Yutaka; Matsuzawa, Hiroshi; Iwata, Kaoru

PA Teijin Ltd., Japan

SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 8 pp.

CODEN: JKXXAF

DT Patent

LA Japanese

FAN.CNT 1

PATENT NO. KIND DATE APPLICATION NO. DATE

JP 02193954 A2 19900731 JP 1989-11861 19890123

PI JP 02193954 OS MARPAT 114:193378

The multilayer film, with periodical structure in the thickness orientation, comprises C10-22 linear alkylamine salt of arom. conjugated acid R(CH:CH)lCH:C(CN)CO2H [1 = 0,1,2; R = (substituted) arom. residue]. Me cyanate and p-dimethylaminocinnamoyl aldehyde were treated to give 5-(4-dimethylaminophenyl)-2-cyano-2,4-pentadienoic acid (I). The soln. of I and a soln. of C18H37COCHNHCOC6H4C18H37CO(CH2)2O(CH2)4NMe3Br were repeatedly contacted to give the multilayer film useful for elec. materials, waveguides, optoelec. devices, etc.

❸公開 平成2年(1990)7月31日

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平2-193954

庁内整理番号 @Int.Cl. 3 識別記号 C 07 C 235/52 8519-4H 255/41 271/02 6761-4H 8217-4H J // C 09 B 23/00

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

薄膜規則性構造体 60発明の名称

> 20特 頤 平1-11861

願 平1(1989)1月23日 29出

@発 明 者 竹 谷 東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人株式会社東京研

東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人株式会社東京研 伽発 明 者 松 沢 博 志 究センター内

東京都日野市旭が丘4丁目3番2号 帝人株式会社東京研 \blacksquare 薫 @発 明 岩

究センター内

勿出 顯 人 帝人株式会社

大阪府大阪市東区南本町1丁目11番地 四代 理 人 弁理士 前田 純博

> 明 細 御

1. 発明の名称

薄膜規則性構造体

2. 特許請求の範囲

1. 膜の厚み方向に周期性を有し、下記一般式 (I) で表わされる含芳香族共役カルポン酸、

Ar- (CH=CH)
$$_{\ell}$$
 - CH=C(CN) - COOH... (I)

┌式中、ℓは0,1または2を示す。Ar-は置 換または無置換芳香族基を表わす。

と炭素数10~22の直鎖アルキル基を含むアミン との塩から主としてなることを特徴とする累積 膜。

2. 一般式(I)で表わされる含芳香族共役カ ルポン酸のAr-が無置換の炭素数5~14の芳香 族基または一価のアルキル基、ジアルキルアミ ノ基、アルコキシ基、アルキルチオ基、ニトリ ル基。ニトロ基、アルコキシカルポニル基、ア

シルオキシ基、カルバモイル基及びアミド基か らなる群より選ばれる一種で置換された炭素数 5~14の芳香族基からなることを特徴とする請 求項1記載の累積膜。

3. 炭素数10~22の直鎖アルキル基を含むアミ ンが下記一般式(Ⅱ)で表わされるアミンであ ることを特徴とする請求項1記載の累積膜。

$$-A'r - O - (CH2) n - N < W \cdots (II)$$

式中、『』は同一または異なる10~22の整ち 数、n は2~14の整数、k は2または3、 -A'r-は炭素数6~14の二価の芳香族炭化 水素基、一Q及び一Wは同一または異なる水 | 素原子または炭素数1~5のアルキル基を表した。

4. 下記一般式(I)で表わされる含芳香族共 役カルポン酸、

Ar- (CH = CH) $_{\ell}$ - CH = C(CN) - COOH... (I)

【式中、ℓは0,1または2を示す。Arーは置 換または無置換芳香族基を表わす。

を含む水溶液の表面に、炭素数10~22の直鎖アルキル基を含むアミンを展開することにより得られる単分子膜を基板上に累積することを特徴とする含芳香族共役カルボン酸と直鎖アルキルアミンとの塩から主としてなる累積膜の製造法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、規則性薄膜構造体、詳しくは、分子内に親水基と疎水基を有する構造の分子において、 親水ー疎水のバランスが保たれた分子膜を膜の厚 み方向に規則的な周期性に累積された薄膜構造体

種用途への応用展開の途が閉ざされていることが 多い。近年、この欠点を克服するためにラングミ ュアープロジェット法(LB法)が主として用い られるようになった。このLB法は、分子内に親 水茎と疎水基を有する構造の分子において、親水 一疎水のパランスが保たれている時、該分子は水 面で親水基を下に向けた単分子膜を形成すること を利用して、一分子の厚みで規制された累積膜を 作成する方法をいう。一般に広い面積では分子は、 水面上で粗な状態で存在するが、面積を逐次低下 させると、該分子の分子間力によって相互作用の 結果、二次元的な固体膜になる。この状態で適当 な基板に転移させることで単分子膜、または単分 子膜を重ねて案積膜を形成させることができる。 ところが、このような状態で累積転移が行なわれ るためには、その条件を設定することが難しく、 有概分子の化学構造、単分子膜展開条件、基板材 の材質、表面状態等各種の因子が複雑に混じり合 うために、所望するような規則的構造体を作成す るために多くの困難をともなうのが実情である。

とその製造方法に関する。この構造体は、電気絶 縁材料、耐摩耗用保護膜、電子材料での半導体素 子、導波路、電気光学素子、非線形光学材料等の 各種材料への応用が出来るものである。

[従来技術]

しかしながら、いずれの方法も、得られる膜の構造の規則性を完全に制御することは、かなり難 しいのが現状である。このような構造の不規則性 の特徴の為に、有機材料の薄膜に期待される各種 の概能を充分に発揮することが出来なくなり、各

また、LB膜法の特徴から判るように、単分子膜、累積膜を構成するには、疎水基同士の凝集の変質であるために、当該分子は、長鎖で、かの遺状の炭化水素基を有していなければならず、低分子の親水性の分子では水層への溶解が生起し、上述の規則性構造体を形成することは出来なりり配定されたものにならざるを得ず、産業実用上問題になることが多い。

[発明の目的]

本発明は、膜の厚み方向に規則性が優れた新しい構成物質からなる規則性薄膜構造体を提供するのを目的とすると共に、水溶性低分子を規則性薄膜構造体の主要な構成成分として導入されることを特徴とする新規な規則性薄膜構造体、並びにその製造法に関することを目的とする。

[発明の構成]

本発明者は、前記目的を達成すべく鋭意研究の結果、炭素数10~22の直鎖アルキル基を含むアミンが、それ自身では凝集体を構成しえない下記ー

般式(I)で表わされる含芳香族のカルボン酸誘導体とで、アンモニウム造塩体を形成させることで、下記一般式(I)の水溶性カルボン酸が膜の厚み方向に規則的な周期性で存在する薄膜が形成されることを見いだした。

即ち、本発明は、膜の厚み方向に周期性を有し、 下記一般式(I)で表わされる含芳香族共役カル ボン酸、

Ar- (CH = CH)
$$_{\rho}$$
 - CH = C(CN) - COOH... (I)

式中、 ℓ は 0 , 1 または 2 を示す。 A Γ ー は 置換または 無 置換 芳香族 基を 表わす。

と炭素数10~22の直鎖アルキル基を含むアミンと の塩から主としてなることを特徴とする累積膜で ある。

また、本発明は、下記一般式(I)で表わされる含芳香族共役カルボン酸、

$$Ar-(CH=CH) \ell-CH=C(CN)-COOH\cdots(I)$$

~14の芳香族基が用いられる。

無置換の炭素数 5~14の芳香族基としてはフェニル基,ナフチル基及びアンチル基などがある。

躍換された炭素数5~14の芳香族基へ置換している、一価のアルキル基としては、メチル基、プロピル基、プチル基、ペンチル基などがある。アルコキシ基としては、メトキシ基、エトキシ基、プロピルオキシ基などがある。アルキルチオ基としては、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基などがある。

一般式(I)で表わされるカルボン酸は、カルボキシル基を接続する同じ炭素にシアノ基を置換しているためにその酸性が高い。この為に、アミンと容易に安定な塩を形成することができる。かかるカルボン酸としては、3ー(4ーメトキシフェニル)ー2ーシアノプロペン酸。3ー(4ープロピオキシフェニル)ー2ーシアノフェニル)ー2ーシアノフェニル)ー2ーシアノフェニル)ー2ーシアノブロペン酸。3ー(4ージエチルアミノフェニルフミーシアノブロペン酸。3ー(4ージエチルアミ

式中、ℓはO。1または2を示す。Arーは置換または無置換芳香族基を表わす。

を含む水溶液の表面に、炭素数10〜22の直鎖アルキル基を含むアミンを展開することにより得られる単分子膜を基板上に累積することを特徴とする含芳香族共役カルボン酸と直鎖アルキルアミンとの塩から主としてなる累積膜の製造法である。

炭素数10~22の直鎖アルキル基を含むアミンはアルキルハライド塩で使用することが好適である。一般式(I)で表わされる含芳香族共役カルボン酸を含む水溶液はpH5~13、温度1~45℃がよい。得られた単分子膜は2~50mN/mの圧力で累積することができる。

一般式(I)で表わされる含芳香族共役カルボン酸のArーで表わされる部分は、無置換の炭素数5~14の芳香族基または一価のアルキル基,ジアルキルアミノ基。アルコキシ基、アルキルチオ基、ニトリル基、ニトロ基、アルコキシカルボニル基、アシルオキシ基。カルバモイル基及びアミド基からなる群より選ばれる一種で置換された炭素数5

ノフェニル)-2-シアノプロペン酸,3-(4 -ジプロピルアミノフェニル)-2-シアノプロ ペン酸, 3-(4-メチルチオフェニル)-2-シアノプロペン酸, 3-(4-エチルチオフェニ ル)-2-シアノプロペン酸,3-(4-プロピ ルチオフェニル) -2-シアノプロペン酸, 3-(4-シアノフェニル)-2-シアノプロペン酸, 3-(4-ニトロフェニル)-2-シアノプロペ ン酸、3-(4-アセトアミドフェニル)-2-シアノプロペン酸、3-(4-プロピルアミドフ ェニル)-2-シアノプロペン酸, 3-(4-ジ メチルアミノペンゾイル) -2-シアノプロペン 酸、3-(4-アセトキシフェニル)-2-シア ノプロペン酸、3~(4-メチルオキシベンゾィ ル)-2-シアノプロペン酸、3-(4-メチル フェニル)-2-シアノプロペン酸,3-(4-エチルフェニル) - 2 - シアノプロペン酸, 5 -(4-x)+20ペンタジエン酸, 5-(4-エトキシフェニル) - 2 - シアノ - 2,4 - ペンタジエン酸、5 - (4

ープロピルオキシフェニル)-2-シアノ-2.4 - ペンタジエン酸、5-(4-プチルオキシフェ ニル)-2-シアノ-2,4 -ペンタジエン酸,5 - (4-ジメチルアミノフェニル)-2-シアノ -2.4 -ペンタジエン酸, 5-(4-ジェチルアミノフェニル) - 2 - シアノ - 2.4 - ペンタジェ ン酸, 5-(4-ジプロピルアミノフェニル)-2-シアノ-2,4-ペンタジェン酸,5-(4-メチルオキシベンゾイル) - 2 - シアノ-2.4 -ペンタジエン酸、5-(4-メチルフェニル)-2-シアノ-2.4 -ペンタジェン酸, 5-(4-エチルフェニル)-2-シアノ-2,4 -ペンタジ エン酸,5-(4-メチルチオフェニル)-2-シアノー2.4 ーペンタジエン酸、5-(4-エチ ルチオフェニル) - 2 - シアノ-2.4 - ペンタジ エン酸, 5-(4-プロピルチオフェニル)-2-シアノ-2,4 -ペンタジエン酸,5-(4-二 トロフェニル) - 2 - シアノ-2,4 - ペンタジエ ン酸, 5-(4-シアノフェニル)-2-シアノ -2.4 -ペンタジエン酸、5-(4-7セトアミ

6 - ヘキサトリエン酸, 7 - (4 - エチルフェニ 7-(4-メチルチオフェニル)-2-シアノー 2,4,6 - ヘキサトリエン酸, 7- (4-エチルチ エン酸, 7-(4-プロピルチオフェニル)-2 -シアノ-2,4,6 -ヘキサトリエン酸, 7-(4 サトリエン酸, 7-(4-シアノフェニル)-2 -シアノ-2,4,6 -ヘキサトリエン酸, 7-(4 -アセトアミドフェニル)-2-シアノ-2,4,6 - ヘキサトリエン酸, 7- (4-プロピルアミド フェニル) - 2 - シアノ - 2,4,6 - ヘキサトリエ ン酸, 7-(4-メチルアミノベンソイル)-2 ーシアノー2,4,6 -ヘキサトリエン酸,7-(4 - アセトキシフェニル) - 2 - シアノ - 2, 4, 6 -ヘキサトリエン酸、などを挙げることができる。 これらのシアノカルポン酸の共役連鎖は、相互に トランスであるほうが構造上安定であるが、必ず しもすべてトランスであることが本発明の必須条

ドフェニル) - 2 - シアノ - 2,4 - ペンタジエン 酸, 5-(4-プロピルアミドフェニル)-2-シアノ-2,4 -ペンタジエン酸,5-(4-メチ ルアミノベンゾイル)-2-シアノ-2,4-ペン タジエン酸, 5-(4-アセトキシフェニル)-2-シアノ-2.4 -ペンタジエン酸, 7-(4-メトキシフェニル) -2-シアノ-2,4,6-ヘキ サトリエン酸, 7-(4-エトキシフェニル)-2-シアノ-2,4,6-ヘキサトリエン酸、7-(4-プロピルオキシフェニル)-2-シアノー 2,4,6 - ヘキサトリエン酸, 7- (4-プチルオ + > 7 = -10 - 2 - > 7 - 2, 4, 6 - 9 = 10リエン酸、7-(4-ジメチルアミノフェニル) - 2 - シアノ - 2, 4, 6 - ヘキサトリエン酸, 7 -(4-ジエチルアミノフェニル)-2-シアノー 2,4,6 - ヘキサトリエン酸, 7- (4-ジプロピ $\nu r = 1.4.6 - 1.4.6$ サトリエン酸、7-(4-メチルオキシベンゾイ ν) -2-シアノ-2,4,6 - 0 + + 0 +

件であることはない。

炭素数10~22の直鎖アルキル基を含むアミンと しては下記一般式(Ⅱ)で表わされるアミンがある。

式中、m、m'は同一または異なる10~22の整数、n は2~14の整数、k は2または3、-A'r-は 放素数6~14の二価の芳香族炭化水素基、-Q及び-Wは同一または異なる水素原子または 炭素数1~5のアルキル基を表わす。

一般式(I)において-A'r -として、フェニレン基。ピフェニレン基。ナフチレン基。ピナフ

チレン基、アンスレニル基などがある。

Q及びWとして、水素原子、メチル基。エチル基、プロピル基、ロープチル基、ローペンチル基などがある。

一般式(Ⅱ)に示すアミンは、基本的骨格を2 塩基アミノ酸に準拠しており、グルタミン酸。ア スパラギン酸の誘導体であればよい。特にカルボ ン酸基が直鎖状の長鎮の炭化水素エステル置換さ れていることが規則性薄膜構造体を形成させるの に必須であり、炭化水素の炭素数は、10以上22以 下であることが望ましい。10以下であれば、炭化 水素基同士の凝集力が弱すぎるために安定な単分 子膜が形成されず、また炭素数が22以上であれば、 疎水基効果が強すぎるために炭化水素基が折れ曲 がるような現象が生起して、本発明の目的とする 規則的構造体が形成されない。一方、一般式(Ⅱ) のアミノ基は、芳香族アミドで修飾されておれば よく、かかる芳香族基としては、上記のものが選 ばれるが、実用上、また構造安定上、フェニレン 基が最も望ましい。この芳香族基は、オキシメチ

薄膜構造体の形成は、前記公知のラングミュー アプロジェット法(LB法)によって行うことが できる。特に、通常では、累積橋造体を形成させ るのが困難な低分子のカルボン酸(I)を規則性 薄膜構造体として形成させることが可能となる。 かかる目的の為に、カルポン酸(I)をそのまま で、あるいは1~3価の金属水酸化塩、あるいは 炭酸塩, 重炭酸塩を含む、pH5~13の水溶液に加 え、カルボン酸の金属塩を一旦形成させた後、そ の温度を1~45℃として、この水相に前記一般式 (Ⅱ)で示されるアミンを展開、静置することで、 ·カルボン酸の長鎖アミン塩を形成させることがで きる。この時、前記アミンは炭素数1~10のアル キルハライドを形成していることが望ましく、こ のハライドはカルボン酸の金属塩と水溶性の無機 の塩を形成して、所望とする長鎮アンモニウム塩 が形成されることとなる。

このようにして、形成された長鎮アンモニウム 塩は、適当な清浄な基材の上に一定圧力下、望ま しくは2~50mN/m の圧力で、常法により写し取 レン基で接続されているが、メチレン基の繰り返しは、構造の安定性の観点から2~14であればよい。このメチレン基の一方の端は、1~4級のアミノ基になっていることが必須で、このアミノ基が、一般式(I)のカルボン酸と安定な塩を形成する。

構造式(II)で示されるアミンは、一般には二分子膜形成材料として公知である。該アミレえ独なけでは、水面上で安定な単分子膜を形成させる。凝集膜を形成させるを水切ったが知られているのようなポリマーを水切ったのようなのはのかであるが、低分子の、低分子の、ないにのようなな、本発明により低分子の、というである。と有することが見いだされたわけである。

一般式 (Ⅱ) に示すアミンとしてグルタミン酸オクタデシル誘導体,グルタミン酸ドデシル誘導体がある。

ることができる。一般にこの圧力以下では、安定な単分子膜が形成されず、またこの圧力以上では 単分子膜に崩壊が生起し、所望とする累積膜が得 られない。

上述の薄膜構造体は、膜の厚み方向の規則性が 良好な為に、例えば電気絶縁材料、電子材料の半 導体素子材料として用いることもできるし、表面 の平滑性、規則性構造の特性のために、導波路、 非線形光学素子、電気光学素子ら各種光学素子へ の応用が可能となる。

[実施例]

以下に実施例をあげて本発明を詳述する。

合成例1

<u>5-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-シア</u> <u>ノー2,4-ペンタジエン酸(1)の合成</u>

応移了後、12Nの塩酸50mに加えて固体を回収する。この固体をエタノールで再結晶を2回繰り返し目的物6.38g を得た。融点218~219 ℃,元素分析値 C 68.40 %,H 5.88%,N 11.30 %であり、計算値 C 69.63 %,H 5.84%,N 11.56 %と良い一致を示した。赤外吸収スペクトル:2216cm⁻¹ にCN基,1673cm⁻¹ にCOOH基,1615,1586,1551cm⁻¹ にペンゼン環,並びに共役二重結合の存在を認めた。NMRスペクトルには、3.08ppm にメチル基による吸収,6.80,7.60ppm にベンゼン環に基づくAB型吸収を認めた。λ max は、440 nmであった。

合成例2

3-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-シアノプロペン酸(2) の合成

13.77gの水酸化ナトリウムの400 配水溶液にシアノ酢酸メチル34.80gを溶解させた後、窒素雰囲気下にロージメチルアミノベンズアルデヒド34.01gを加え、エタノール200 配を加えて均一溶

被とする。遠流下51時間攪拌を続けた後、12規定 塩酸に反応液を加え沈澱を得る。この固体をメタ ノール/エタノール混合液で再結晶を2回繰り返 し13.51gの針状結晶を得た。収率37%,融点226 ~228 ℃,元素分析値C66.82 %,H5.56%,N 12.76 %となり、計算値C66.14 %,H5.60%, N12.96 %と良い一致を示した。 λ max は399nm であった。

同様の方法で、別表1の各種カルボン酸を合成 した。

表 1

化合物番号	構 造	(プ) 点点	λ max
3	NOz-CeH4-CH=C (CN) COOH	208	302nm
4	CH3-O-CH4-CH=C(CN)COOH	229	320nm
5	H-CH4-CH=C (CN) COOH	210	295nm
6	Cdds-CH=CH-CH=C(CN)COOH	212	320nm
7	CHs-CH-CH-CH-CH-C (CN) COOH	238	360nm

Amax の測定はメタノール中で実施

実施例1

同仁化学製のグルタミン酸オクタデシル誘導体 (下記式、以下C18GLUと略)

 $C_{18}H_{37}O - CO - CHNH - CO - C_6H_4 - C_{18}H_{37}O - CO (CH_2)_2$

-O (CH₂) 4 N (CH₃) 3 8r 0.43mHのクロロホルム溶液を調製する。

NaOH 0.48mH, 並びに5 - (4 - ジメチルアミノフェニル) - 2 - シアノ - 2,4 - ペンタジエン酸 0.043mH を含む水屑を17℃に設定し、C18G し U のクロロホルム溶液を展開する。約20分静置後、0.5 cm/分の速度で圧縮した。図1に示したように崩壊圧50mN/m と安定な凝集膜の形成が認められた。

上記のように形成された単分子膜を、圧縮圧25 mN/m で垂直浸漬法で、石英板の昇降を繰り返した。基板の下降時には、単分子膜の転移は起こらず、上昇時には転移比1.0 で転移することが観測された。この操作を繰り返したところ再現良く上昇時のみ単分子膜が転移することが認められた。

めた。第4図に示すごとく崩壊圧は、60mN/m以上の安定な膜が形成された。この単分子膜も実施例1と同様に、石英基板に対して下降時には累積されず、上昇時にのみ転移比1.0で累積され、乙膜であることが認められた。この累積膜のX線回折から厚み方向に規則性の存在が認められた。

実施例3

実施例1で示されるC18GLUの代わりに、下記に示すドデシルエステル誘導体(以下C12GLUと略)

 $C_{.12}H_{.25}O - CO - CHNH - CO - C_6H_6 - C_{.12}H_{.25}O - CO - (CH_2)_2$

-O(CH₂)4 N(CH₃)3 Br
0.4mH のクロロホルム溶液を作成し、合成例2で示された3-(4-ジメチルアミノフェニル)2-ジアノプロペン酸を用いる以外は、実施例1
と同じ条件に設定し、単分子膜の形成、並びに累積膜の作成を行った。この累積膜も基板上昇時のみに累積される Z 膜の形成が観測された。

この操作を3回線り返した累積膜の紫外可視スペクトルを第2図に示した。C18GLU単独だけでは、認められない波長430nmの吸収極大(5 ー(4 ージメチルアミノフェニル)-2 ーシアノー2,4 ーペンタジエン酸に該当)が認められ、累積回数に応じて吸光度が増大することが認められた。このことは、5 ー(4 ージメチルアミノフェニル)-2 ーシアノー2,4 ーペンタジエン酸が、C18GLUとアンモニウム塩を形成して、累積膜の構成成分であることを意味している。

この膜の膜厚方向に就いてのX線回折測定をCUK なをX線源にして θ \angle 2 θ 法で測定を行ったところ、第3図に示すような2 θ = 1.52*を主ビークとする明瞭な回折パターンを示し、この累積膜が厚み方向に面間隔が約58Aの規則的な構造を示していることが示唆された。

実施例2

表1の化合物3を用いる以外は、実施例1と全 く同様にして、単分子膜の表面圧-面積曲線を求

実施例4~8

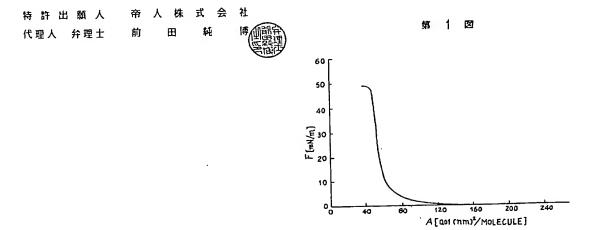
実施例1と同様に累積膜を作成した。表2に結果を示す。

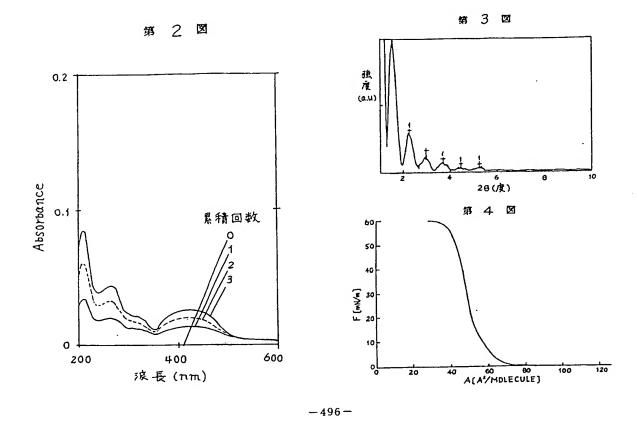
表 2 実施 アミン カルボン 崩壊圧 累積膜形態 例 酸 (m/Mm) (転移比) 4 C18GLU 合成例4 Z(1.01)5 7 40 Z(0.85)6 5 45 Z (0.80) 7 C12GLU 1 42 Z(0.75)8 6 41 Z(0.70)

4. 図面の簡単な説明

第1図は、5-(4-ジメチルアミノフェニル)-2-シアノー2、4-ペンタジエン酸を含むC18GLUの表面圧-面積曲線を示し、第2図は該累積膜の紫外可視吸収スペクトルを示し、第3図は該累積膜のX線回折の小角側のパターンを示す。第4図は、3-(4-ジメチルアミノフェニル)

- 2 - シアノプロペノン酸を粗む C 18 G L U の表面圧 - 面積曲線を示す。





BEST AVAILABLE COPY